PASJ2018 THOL01

ガスシートを用いた二次元ビームプロファイルモニタのための ガス分布測定装置の開発

DEVELOPMENT OF GAS DISTRIBUTION MEASUREMENT SYSTEM FOR A TWO-DIMENSIONAL BEAM PROFILE MONITOR WITH A SHEET-SHAPED GAS

山田 逸平 *A,B), 荻原 徳男 ^{C)}, 引地 祐輔 ^{A)}, 神谷 潤一郎 ^{A)}, 金正 倫計 ^{A)}

Ippei Yamada^{* A,B)}, Norio Ogiwara^{C)}, Yusuke Hikichi^{A)}, Junichiro Kamiya^{A)}, Michikazu Kinsho^{A)}

A)J-PARC center (JAEA)

^{B)}Graduated School of Science and Engineering, Doshisha University

^{C)}J-PARC center (KEK)

Abstract

The beam profile monitor is needed for measuring one of the beam parameters of high intensity accelerator to avoid radioactivating the systems. A monitor with sheet-shaped gas can measure the beam profile nondestructively in two dimensions. One of issures to introduce the monitor in accelerator is that the gas distribution is not homogeneity. Obtaining correct beam profile data needs gas distribution. The device to measuring gas distribution in three dimensions is developing. When an electron beam pass through the gas sheet, the gas molecule is ionized and ions are produced. Electric field guides the ions to a micro channel plate(MCP) that increases intensity of signal. A phosphor detects the electrons emitted from MCP. Finally, the image in the phosphor is taken photo that has one-dimensional distribution data. The three dimensional distribution data are obtained by moving gas sheet in two dimensions. In this paper, the details of this device and the region that the device can measure distribution are reported.

1. はじめに

大強度陽子加速器施設 (J-PARC) は 400 MeV の線形 加速器 LINAC、3 GeV シンクロトロンの RCS、および 50 GeV シンクロトロンの MR の 3 つの加速器から成 り、RCS でのビーム出力で1 MW の運転に向けて調整 中である。このようなビーム強度での加速器の運転で は、わずかなビームロスでも機器が放射化し、安定な加 速器運転の妨げや保守点検作業時間を制限することにつ ながる。安全かつ安定な運転を行うためにはビームの位 置、エミッタンス、プロファイルなどをモニタリングし、 ビームロス原因を特定して対処する必要があるため、こ れらのモニタは必須である。ビームプロファイルモニタ に関しては、現在主流のワイヤモニタは精度よく測定で きる反面、大強度ビームでワイヤが損傷する、そのため ユーザー利用運転中は測定できない、および測定に時間 がかかるなどの課題点がある。これらを解決する一つの 方法として、中性ガスを積極的に導入するものが開発さ れており [1,2]、J-PARC ではシート状に形成したガスを 導入する方式のモニタの開発が進められている [3]。こ のモニタは、シート状のガスを局所的に導入し、そのガ スとビームの衝突に伴い発生するイオンないしは光を検 出するものである。そのため、ビームの二次元プロファ イルの測定が可能であり、希薄なガスを利用することか ら大強度ビームの測定でもモニタが破損せず、ビームに 対して非破壊なモニタである。測定原理を Fig. 1 に示 す。加速器ビームの横方向断面を切るようにシート状の 中性ガスを発生させる。この時、ガスシートはビーム平 行方向に対して角度θで導入する。このシート中のガス と加速器ビームの衝突によりガスのイオン化および発

光が生じる。このうちイオンを電場で誘導し MCP を通 して蛍光板で検出し、カメラで撮影しプロファイルデー タとする。あるいは発生した光を光学系を用いて輸送 し、CCD カメラで撮影しプロファイルデータとする。こ の時、ガスシートは必ずしも3次元的に一様ではなく分 布を持つため、より正確なプロファイルデータを得るた めにはこの分布を測定し、データを換算する必要がある。 本稿では、このガスシートの3次元分布を測定するため の装置を発案し、分解能、得られる信号強度、およびシ ミュレーションに基づくイオン軌道の検証を行ったので 報告する。



Figure 1: The schematic diagram of the beam profile monitor with sheet-shaped gas.

^{*} ip_yamada@icloud.com

2. 実験原理

ガスの3次元分布測定装置の原理を述べる。概要と しては、Fig.1に示したイオン検出型のプロファイルモ ニタの原理に着目し、プロファイルが既知の電子ビーム をガスに照射して生じたイオンの位置情報からガス分布 を得るというものである。測定原理について詳細に述べ



Figure 2: The schematic diagram of the gas distribution measurement system.

る。Figure 2 に示すように、測定するガスシートをビー ムに対して角度 θ で導入し、電子ビームを照射する。こ れにより生じるイオンを電場を用いて MCP に誘導し、 信号を増幅したのち、蛍光板を用いて検出する。この時、 Fig.3に示すように、ガスシートに対してシート面を x,y 方向、厚み方向をz方向として定義すると、得られるガ ス分布は x,z 成分を持った情報を cosθ で射影したものと なる。この情報を x および z 成分に分解することは困難 であるため、ビーム進行方向をs軸と定義し、あるシー ト生成器位置での s 方向成分のデータとする。ガスシー トを xy 平面で移動して同様の測定を行う。この時、測 定位置は常に Fig. 4 の濃い青の領域であり、シートを移 動することで薄い青の領域のデータが蓄積する。すなわ ち、ガスシートが移動しても電場が変化せずイオン軌道 が一定であれば、濃い青のある点で発生したイオンは常 に蛍光板上の同じ位置で検出されるため、得られる画像 データを解析することで、3次元分布とすることができ る。また例として、濃い青と一つ右の薄い青のある測定 点の緑の領域に着目すると、その中間にある白い領域は 緑の領域の値の 1/2 ずつの和となる。このように得られ たデータをs方向からz方向に変換し、x,y,z系での3次 元分布とすることができる。 次に測定分解能について 述べる。得られる測定データはビーム径が十分小さく無 視できるとすれば任意に分割できるが、ビーム径が d の 場合は Fig. 4 のように、d/cosθ ごとに分割する必要が ある。したがってこれが x 方向の分解能となり、ビーム 径で決まる。得られる情報に x,z 成分が含まれているこ とから、x 方向分解能に付随して z 方向の分解能もビー ム径に依存し、d/sinθ となる。y 方向については x,z と は独立であるが、同様にビーム径 d 程度とする。また、 MCP および蛍光板の分解能は 0.1 mm 程度である。ガ



Figure 3: The obtained data and the processing way of the data to gas distribution.



Figure 4: The obtained data and the processing way of the data to gas distribution.

スシートの厚みは全値半幅で 1 mm 程度であるという計 算結果 [4] があるため、分解能としては十分である。

次に得られる信号強度について見積もる。既存の電子 銃を用いることを考え、エネルギー 30 keV、ビーム径 0.5 mm、ビーム電流 10 μ A に対し、ガスシート部の圧力 を 10⁻⁴ Pa、厚みを 5 mm と仮定すると、断面積は 10⁻¹⁸ cm² であること [5] から、発生するイオンの数は 10⁶ 個/s 程度となる。これは電流に直すと 0.1 pA オーダであり、 MCP で 10⁶ 倍で増幅されると考えれば、0.1 μ A オーダ となる。この電流量であれば蛍光板で十分に検出可能で ある。

以上が測定原理であるが、この分布測定において正確 なガス分布情報を取得するために最も重要な点は、シー ト生成器の移動に対してイオン軌道が一定であるかとい うことである。シート生成器の移動により金属境界の位 置が変化するため、電場を変動させると予想される。し たがって、計算に基づいた電位配置を行い、イオン発生 位置に対してイオン軌道が一意的であるか確認する必要 がある。次節ではイオン軌道計算を詳細に行った結果を 示す。

3. イオン軌道計算

本節では有限積分法を主としている CST studio [6] を用いてイオン軌道計算を行った結果を示す。直径 0.5 mm の電子ビームが厚み 5 mm の一様に分布した N_2 ガ スシートに入射するとして、直径 0.5 mm、高さ 7 mm(= 5 mm/sin45°) の 45 度傾いた円筒型粒子ソースを仮定し

PASJ2018 THOL01

た。この円筒の側面から垂直向きに 300 K の Maxwell 分布の熱速度を初速として与えた。本来はシートに明確 な境界は存在しないが、z 方向のイオン発生位置に対す る測定精度を調べることでどの領域の測定が可能である かを見積もるため、この仮定のもと計算を行った。

3.1 計算モデル

次に計算を行ったモデルについて説明する。イオン軌 道付近に金属境界が存在すると、電場に影響を与え軌道 が乱れると予想されるため、ガスシート中心位置と測定 精度の関係を調べた。まず座標系として Fig. 5 のよう に、電子ビームと MCP の中心軸との交点を原点と定義 して、ガスシートの中心の座標を Xc, Yc とする。ガス シート生成器の形状はより高密度、均一なシートを形成 できると予想されている円形 [4] を仮定し、境界は半径 25 mm、高さを半径以下の xy 平面に垂直方向な円筒の側 面とし、後の議論のためにそれぞれ D,T_{slit} と定義する。 また生成器全体の系は 200 mm を仮定した。さらに、外 径 60 mm、開口部 28 mm の GND 電極にカバーされた MCP を、電子ビームに干渉しないようにガスシート中 心から 30 mm 離して設置した。



Figure 5: The model of gas sheet slit and MCP geometry.

3.2 電位配置および電子ビームへの影響

まず、電位配置について述べる。シート生成器の移動 により電場の形が変化しないような電位配置に加えて、 イオンの初速度による位置情報に対するノイズの影響 が少なくなるような配置にする必要がある。これらの課 題に対して、シート生成器の移動で電位系の変化がなく なるように金属メッシュをシート生成器の上下面に設置 し、また初速度の影響を小さくし直線的にイオンを輸送 するために円筒の電極を追加し、メッシュ、円筒電極、 および MCP の電位を同電位とした (Fig. 6)。これによ り、イオンが受ける電場は金属メッシュ中の直線的な電 場が支配的となり、イオン発生から検出まで直線的に輸 送することができる。この結果、Fig. 6のように、Xc= 0,0.6D についてはイオン軌道に大きな変化は見られな かったが、Xc=0.8D についてはシート生成器の存在によ りイオンソース付近の電場に影響があるため大きく軌道 が乱れる結果となった。この時、電子ビームは金属メッ シュ、円筒電極を貫通する必要があるため、電子ビー ムの軌道上に穴を開けることで対処する。しかし、電子 ビームのエネルギーがメッシュ電位と同程度であれば大 きく影響を受けるため、金属メッシュに与える電位が制 限される。今回の計算では対向電極メッシュに5kV、も うー方のメッシュ、円筒電極、MCPには-5kVを印加し、 電子ビームのエネルギーを30keVとした。これにより、 電子ビームは約0.25mm(ビーム径の50%)程度z方向 上下に移動した。また、イオンの初速度の影響を低減す るために、メッシュを5kVとしたが、電子ビームのエ ネルギーを35~25kVに変化させる結果となった。これ により電離断面積が2割程度増減するため、正しいガス 分布情報が得られない。そのため、Fig. 6の結果を用い て電子ビームのエネルギー変化にともなう断面積の変化 を考慮し、データを補正する必要がある。

3.3 軌道計算結果

上記の条件を固定して、分布測定可能な空間的範囲に ついて調べた。ガスシートの直径が xy 平面で 2D(=50 mm) であるため、Xc を-0.8D~0.8D、Yc を 0~0.8D (y 方向に関しては対称形であるため)の範囲で動かし、その 時の MCP 上で検出される点の分布を比較した。Figure 7にT_{slit}=0.2D、(Xc, Yc)=(0,0), (0.8D,0)の時の検出分 布例を示す。赤のプロットが検出点で、青の線が MCP から見たイオンソースの概形である。Xc=0の場合、青 の枠に対して x 方向の検出幅はほとんど同じ大きさで、y 方向の検出幅はイオンの初速度の影響で約1.5倍となっ た。また、Xc = -0.8D の場合のように、Xc や Yc が大き な値をとる場合は大きく分布形状が変化する。この分布 形状が測定位置によって変化すると、ガスシートの形状 の位置依存性が得られない。これを定量的に評価するた め、各(Xc, Yc)の点の分布に対してある幅を持った短冊 を考え、その内部の点の数 n をプロットしたヒストグラ ムを作成した結果を Fig. 8 に示す。各々のヒストグラム の比較を行うために、(Xc, Yc)=(0,0)のヒストグラムに 対する任意の (Xc, Yc) のヒストグムの偏差を以下の式の ように計算した。

$$s = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (n_i - n_{i0})^2}$$
(1)

ただし、 n_i は任意の (Xc, Yc) のヒストグラムの i 番目 の要素の度数、 n_{i0} は (Xc, Yc)=(0, 0) のヒストグラムの i 番目の要素の度数、N はヒストグラムの要素の総数で ある。この時、各要素の検出点数の平均値 \overline{n} を用いて

$$\text{Error} = \frac{s}{\overline{n}} \tag{2}$$

をシート生成器の移動により生じる誤差と定義して各パ ラメータを変化させた時のグラフを比較した。

まず、(Xc, 0)、(0, Yc) で Xc, Yc を変化させた場合の x 軸への射影、y 軸への射影に対する誤差 $e = s/\overline{n}$ の変化 を Fig. 9(a),(b) に示す。(a) のグラフより、Xc を変化さ せた場合は x 軸に沿った分布の変化が、y 軸に沿った分 布の変化より大きいことがわかる。誤差の大きい x 軸に 沿った分布の変化(赤のプロット)に着目すると、Xc が 大きくなるに従い急激に誤差が大きくなっていることが 読み取れる。したがって、誤差が小さく、一定とみなせ る範囲を決定することができ、測定可能範囲とすること ができる。一方、Yc を変化させた場合は y 軸に沿った

Proceedings of the 15th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 7-10, 2018, Nagaoka, Japan

PASJ2018 THOL01



Figure 6: The example of potential and electric field geometry at Xc = 0, 0.6D, and 0.8D. The ion and electron beam trajectories with those geometry.



Figure 7: The ion detection distribution on MCP at Xc = 0 and Xc = 0.8D.

分布の変化の方が大きい結果となった。以降は Xc を変 化させた場合は x 軸への射影、Yc を変化させた場合は y 軸への射影によって得られたヒストグラムの比較を行 う。

次にシート生成器の厚み T_{slit} を 0.04D~0.4D で変化 させた場合の誤差の変化を Fig. 10 に示す。この場合、 T_{slit} が小さいほどより大きな Xc,Yc の値まで小さな誤 差で測定できることが読み取れる。ただし Xc,Yc=0.8D においては、イオン発生部が金属境界に非常に接近して いるため、軌道の乱れ方が大きく、x,y 軸への射影によっ てその影響が低減されたため、今回の評価方法では評 価できていないと考えられる。そこで Xc,Yc=0.6D まで を拡大すると Fig. 11 となる。例えば誤差 5% 程度で測



Figure 8: The histogram of Figure 9 against x axis.

定を行う場合、 $T_{slit} = 0.04D$, 0.1D において Xc=0.6D まで測定可能である。Yc に関しては 0.4D まで、もし くは $T_{slit} = 0.04D$ においては 0.6D まで測定可能であ る。すなわち、 $T_{slit} = 0.04D$ では半径 0.6D の円内、 $T_{slit} = 0.1D$ では x 方向に 0.6D、y 方向に 0.4D の楕円 内で測定可能であるということを示している。ここで、 ガスシートを用いたビームプロファイル測定を考えると ガスシートは加速器ビームに対してある角度を持って導 入するため、ビームから見た円形の領域は本稿で定義し た x,y 座標では楕円形となることを考慮すると、測定が

PASJ2018 THOL01



Figure 9: The detection error against moving gas sheet slit along x and y axes at $T_{slit} = 0.2D$.

必要な領域は楕円形であると言える。したがって、上述 の議論で言えば、T_{slit} = 0.04D, 0.1D どちらの場合で もプロファイル測定時に導入する角度が 45 度程度まで ならば、利用できるガス分布情報は同程度である。 最後



Figure 10: The characteristics of errors as function of the slit center position.



Figure 11: The expand graph of Figure 10.

に z 方向の測定可能範囲に関して述べる。測定範囲の制 限は金属境界の存在によりイオン軌道が乱れることに起 因するため、境界とイオン発生源の位置関係によって決 まる。これはイオン発生源のサイズを変化させることで 確認できるが、イオン発生源のサイズが一定の場合でも T_{slit}を変化させることで、相対的な変化としてイオン発 生源のサイズを変化させたことと同等であるため、上記 の議論に組み込まれている。したがって、Fig. 10のグラ フを用いることでこの装置でのある誤差での測定可能範 囲が決定できる。

また、本稿ではシート径 2D=50 mm についてのみ計 算結果を示したが、シート径を増加させても、シート上 下面には十分大きなメッシュ電極を設置するため、シー ト径の増加による電位配置の変化はイオン軌道に影響を 与えない。シート径のみが大きくなれば 2D/T_{slit} が大き くなるため、相対的に T_{slit} が減少したことと等価であ るため、測定可能範囲は広がると考えられる。

4. まとめ

本稿ではガスシートの3次元分布を測定する装置の開 発を行ったことを報告した。以下に得られた結果、およ び今後の方針についてまとめる。

- 電子ビームを用いてガスをイオン化し、そのイオン を測定することでガス3次元ガス分布測定を行う装 置の発案を行った。
- 電子ビームがメッシュ電極を通過する際、エネル ギー変化によるイオン生成数の非一様性が生じることが得られた。
- 電場計算の結果を用いて電子ビームのエネルギー変化に伴う電離断面積の変化を考慮し、得られるガス分布のデータを補正する必要がある。
- この装置における空間的な測定範囲の評価を行い、 シート生成器の厚みがガスシート径の1/5以下であ る場合、シート径の約半分の径の領域の測定が可能 であるということが得られた。
- 今後、電子銃や電位配置の最終的な決定を行い、この装置の開発を行う。

謝辞

本研究を進めるにあたって、J-PARC センターの皆様 にご協力いただきましたこと感謝いたします。

参考文献

- V. Tzoganis, Hao D. Zhang, A. Jeff, and Carsten P. Welsch, Phys. Rev. Accel. and Beams, 20, 062801 (2017).
- [2] Y. Hashimoto, T. Fujiwara, T. Morimoto, Y. Fujita, T. Honma, S. Muto, K. Noda, Y. Sato, T. Uesugi, and S. Yamada, Nucl. Instrum. Method A, **527** (2004) 289.
- [3] N. Ogiwara, Y.Hikichi, Y. Namekawa, J. Kamiya, M. Kinsho, K. Hatanaka, T. Shima, M. Fukuda, Proc. of IPAC2016, Busan, Korea, WEOBB03.
- [4] N. Ogiwara, J. Vac. Soc. Jpn., 56 (2013) 4.
- [5] Schram B. L., de Heer F. J., Van der Wiel M. J. and Kistermaker J., Physica 31, 94-112 (1965).
- [6] http://www.aetjapan.com/software/CST_Overview.php